



19



SCHWEIZERISCHE Eidgenossenschaft
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

11 CH 693 748 A5

51 Int. Cl.⁷: C 23 C 014/30

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

12 PATENTSCHRIFT A5

21 Gesuchsnummer: 00823/99

22 Anmeldungsdatum: 04.05.1999

24 Patent erteilt: 15.01.2004

45 Patentschrift veröffentlicht: 15.01.2004

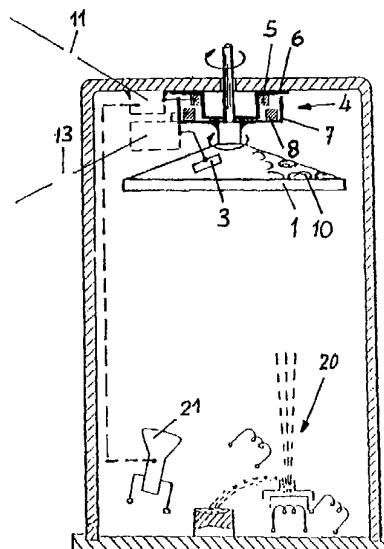
73 Inhaber:
Satis Vacuum Industries Vertriebs AG
Neuhofstrasse 12
6341 Baar (CH)

72 Erfinder:
Rudolf Suter, Stegenstrasse 22
6048 Horw (CH)

74 Vertreter:
Patentanwaltsbüro G. Petschner, Wannenstrasse 16
8800 Thalwil (CH)

54 **Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate.**

57 Die Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate (10), wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf domförmige Trägermittel (1) aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen (20) und gegebenenfalls zusätzlichen Wärmestrahlern (21) umlaufen, umfasst mindestens einen Messfühler (3), insbesondere Temperaturfühler, der an den umlaufenden Trägermitteln (1) für die Substrate (10) in mindestens angenähert deren Beschichtungsebene angeordnet ist, wobei der Messfühler (3) mit elektrischen Schaltungsmitteln (11, 13) in Wirkungsverbindung steht zur transformatorischen Energieübertragung zwischen still stehendem Teil (2) der Beschichtungsanlage und umlaufenden Trägermitteln (1).



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf domförmige Trägermittel aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen und gegebenenfalls zusätzlichen Wärmestrahlern umlaufen.

In der Vakuum-Beschichtungstechnik erweist es sich oft als notwendig, zur Erlangung einer optimalen Schichtqualität die zu beschichtenden Substrate während des Aufdampfprozesses einer definierten, erhöhten Temperatur auszusetzen. Hierfür werden üblich IR-Wärmestrahler eingesetzt.

Grundsätzlich problematisch hierbei ist allerdings die Überwachung der tatsächlichen Temperatur in der Beschichtungsebene mit an sich sinnvoll dort platzierten Temperaturfühlern, da eine anwendbare Messdatenübertragung vom rotierenden Dom auf den stationären Anlageteil bisher nicht ermöglicht werden konnte.

Demzufolge kennt der Stand der Technik nur Fühlermittel am stationären Anlageteil, die allerdings keinen Aufschluss über die tatsächlichen Temperaturverhältnisse in der Beschichtungsebene geben können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist nun, entgegen bisheriger Praxis, bei einer Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf domförmige Trägermittel aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen und gegebenenfalls zusätzlichen Wärmestrahlern umlaufen, die Temperatur in der Beschichtungsebene der Substrate zu erfassen.

Dies wird erfindungsgemäss dadurch erreicht, dass mindestens ein Messfühler, insbesondere Temperaturfühler, an den umlaufenden Trägermitteln für die Substrate in mindestens angenähert deren Beschichtungsebene angeordnet ist, wobei der Messfühler mit elektrischen Schaltungsmitteln in Wirkungsverbindung steht zur transformatorischen Energieübertragung zwischen still stehendem Teil der Beschichtungsanlage und umlaufenden Trägermitteln.

Hierdurch kann nun die elektrische Energieübertragung von einem stationären Primär-Schaltkreis auf einen relativ zu diesem bewegbaren Sekundär-Schaltkreis sowie eine Rückübertragung von im Sekundär-Schaltkreis erzeugten Messdaten auf den Primär-Schaltkreis erfolgen, wobei im Primär-Schaltkreis eine Primärspannung erzeugt und diese transformatorisch auf den Sekundär-Schaltkreis übertragen wird und wobei dann die im Sekundär-Schaltkreis erzeugten Messdaten digital umgeformt und auf dem gleichen transformatorischen Weg auf den Primär-Schaltkreis rückübertragen und dort ausgewertet werden können.

Hierfür umfassen die Schaltungsmittel einen Primär-Schaltkreis und einen Sekundär-Schaltkreis, wobei der Primär-Schaltkreis über einen Transformator mit dem Sekundär-Schaltkreis berührungsfrei gekoppelt ist. Ferner umfasst der Transformator eine Pri-

mär-Spule im Primär-Schaltkreis auf einem stationären Kern und eine Sekundär-Spule im Sekundär-Schaltkreis auf einem relativ zum stationären Kern bewegbaren Kern.

Im Primär-Schaltkreis befindet sich weiter eine Spannungsquelle sowie eine Auswerteeinrichtung für die induzierten Messdaten und im Sekundär-Kreislauf neben dem Messdaten erzeugenden Temperaturfühler eine die Messdaten digitalisierende Auswerteeinrichtung, deren Ausgangssignale einen Kurzschlusszeuger steuern.

Erfindungswesentlich ist dabei, dass die Primär-Spule mit dem stationären Kern und die Sekundär-Spule mit dem bewegbaren Kern coaxial und relativ zueinander umlaufend angeordnet sind.

Hierbei erhält der mit dem Sekundär-Schaltkreis bewegte Messfühler seine Energie transformatorisch aus dem Primär-Schaltkreis, wobei die vom Messfühler erzeugten Strom- und Spannungs-Messdaten zu der Auswerteeinrichtung gelangen und die in digitale Ausgangssignale umgeformten Messdaten einen Kurzschlusszeuger steuern, welcher den Strom im Sekundär-Schaltkreis gemäss dem Messdatenverlauf kurzschliesst. Die hierbei im Primär-Schaltkreis induzierten äquivalenten Strom- und Spannungsänderungssignale gelangen dann zur Auswerteeinrichtung im Primär-Schaltkreis und sind dort in verwertbare Ausgangssignale überführbar, beispielsweise zur Nachregelung der Wärmestrahler.

Eine beispielsweise Ausführungsform der erfindungsgemässen Vakuum-Beschichtungsanlage ist nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vakuum-Beschichtungsanlage, im Schnitt, mit einem Temperaturfühler, der mit elektrischen Schaltungsmitteln in Wirkungsverbindung steht zur transformatorischen Energieübertragung zwischen stillstehendem Teil der Beschichtungsanlage und umlaufenden Trägermitteln; und

Fig. 2 ein Schaltschema der Schaltungsmittel gemäss Fig. 1 mit einem Primär-Schaltkreis, der über einen Transformator mit einem Sekundär-Schaltkreis berührungsfrei gekoppelt ist.

Die gezeigte Vakuum-Beschichtungsanlage dient zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate 10, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf domförmige Trägermittel 1 aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen 20 und gegebenenfalls zusätzlichen Wärmestrahlern 21 umlaufen.

Der Aufbau solcher Vakuum-Aufdampfpanlagen ist so weit bekannt, dass sich eine nähere Konstruktionsbeschreibung erübrigt.

Erfindungswesentlich ist hier zunächst, dass mindestens ein Messfühler 3, insbesondere Temperaturfühler, an den umlaufenden Trägermitteln 1 für die Substrate 10 in mindestens angenähert deren Beschichtungsebene angeordnet ist, wobei der Messfühler 3 mit elektrischen Schaltungsmitteln 11, 13 in Wirkungsverbindung steht zur transformatorischen Energieübertragung zwischen still stehendem Teil 2 der Beschichtungsanlage und umlaufenden Trägermitteln 1.

Wie in Fig. 1 angedeutet und wie das betreffende

Schaltschema in Fig. 2 deutlich macht, umfassen die Schaltungsmittel einen Primär-Schaltkreis 11 und einen Sekundär-Schaltkreis 13, wobei der Primär-Schaltkreis 11 über einen Transformator 4 mit dem Sekundär-Schaltkreis 13 berührungsfrei gekoppelt ist.

Dieser Transformator 4 umfasst eine Primär-Spule 5 im Primär-Schaltkreis auf einem stationären Kern 6 und eine Sekundär-Spule 7 im Sekundär-Schaltkreis auf einem relativ zum stationären Kern bewegbaren Kern 8.

Hierbei befinden sich im Primär-Schaltkreis eine Spannungsquelle 12 sowie eine Auswerteeinrichtung 16 für die induzierten Messdaten und im Sekundär-Schaltkreis, neben dem Messdaten erzeugenden Temperaturfühler 3, eine die Messdaten digitalisierende Auswerteeinrichtung 14, deren Ausgangssignale einen Kurzschluss erzeuger 15 steuern.

Die Primär-Spule mit dem stationären Kern und die Sekundär-Spule mit dem bewegbaren Kern sind koaxial und relativ zueinander umlaufend angeordnet, wie das Fig. 1 erkennen lässt.

Der mit dem Sekundär-Schaltkreis 13 bewegte Messfühler 3 erhält nun seine Energie transformatorisch aus dem Primär-Schaltkreis 11, wobei die vom Messfühler 3 erzeugten Strom- und Spannungs-Messdaten zu der Auswerteeinrichtung 14 gelangen, wobei dann die in digitale Ausgangssignale umgeformten Messdaten einen Kurzschluss erzeuger 15 steuern, welcher den Strom im Sekundär-Schaltkreis 13 gemäss dem Messdatenverlauf kurzschliesst. Die im Primär-Schaltkreis 11 induzierten äquivalenten Strom- und Spannungsänderungssignale sind dann mit der Auswerteeinrichtung 16 im Primär-Schaltkreis 1 in verwertbare Ausgangssignale überführbar.

Durch diese Massnahmen wird es also grundsätzlich möglich, eine elektrische Energieübertragung von einem stationären Primär-Schaltkreis auf einen relativ zu diesem bewegbaren Sekundär-Schaltkreis sowie eine Rückübertragung von im Sekundär-Schaltkreis erzeugten Messdaten auf den Primär-Schaltkreis in einer heute angemessenen Weise zu gestatten, indem im Primär-Schaltkreis eine Primärspannung erzeugt und diese transformatorisch auf den Sekundär-Schaltkreis übertragen wird und dann die im Sekundär-Schaltkreis erzeugten Messdaten digital umgeformt und auf dem gleichen transformatorischen Weg auf den Primär-Schaltkreis rückübertragen und dort ausgewertet werden.

Somit ist es nunmehr möglich, Fühlermittel direkt in der Beschichtungsebene der Substrate anzuordnen und die sich ergebenden Messdaten, wie Temperatur u. dgl., aufzunehmen und zu verwerten.

Selbstverständlich sind im Rahmen der vorbeschriebenen Erfindung eine ganze Reihe von Modifikationen möglich, ohne dabei den Erfindungsgedanken zu verlassen. So kann der Messfühler beliebiger Art sein. Weiter kann der Sekundär-Schaltkreis auch mehrere gleiche oder unterschiedliche Messfühler umfassen. Entsprechend sind dann Auswerteeinrichtung und Kurzschluss erzeuger im Sekundär-Schaltkreis sowie die Auswerteeinrichtung im Primär-Schaltkreis anzulegen.

Es wird Schutz beansprucht wie folgt:

Patentansprüche

1. Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate (10), wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf domförmige Trägermittel (1) aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten (2) oberhalb von Verdampfungsquellen (20) und gegebenenfalls zusätzlichen Wärmestrahlern (21) umlaufen, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Messfühler (3), insbesondere Temperaturfühler, an den umlaufenden Trägermitteln (1) für die Substrate (10) in mindestens angenähert deren Beschichtungsebene angeordnet ist, wobei der Messfühler (3) mit elektrischen Schaltungsmitteln (11, 13) in Wirkungsverbindung steht zur transformatorischen Energieübertragung zwischen still stehendem Teil der Beschichtungsanlage und umlaufenden Trägermitteln (1).
2. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltungsmittel einen Primär-Schaltkreis (11) und einen Sekundär-Schaltkreis (13) umfassen, wobei der Primär-Schaltkreis (11) über einen Transformator (4) mit dem Sekundär-Schaltkreis (13) berührungsfrei gekoppelt ist.
3. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator (4) eine Primär-Spule (5) im Primär-Schaltkreis auf einem stationären Kern (6) und eine Sekundär-Spule (7) im Sekundär-Schaltkreis auf einem relativ zum stationären Kern bewegbaren Kern (8) umfasst.
4. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich im Primär-Schaltkreis eine Spannungsquelle (12) sowie eine Auswerteeinrichtung (16) für die induzierten Messdaten befinden und sich im Sekundär-Schaltkreis neben dem Messdaten erzeugenden Temperaturfühler (3) eine die Messdaten digitalisierende Auswerteeinrichtung (14) befindet, deren Ausgangssignale einen Kurzschluss erzeuger (15) steuern.
5. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Primär-Spule mit dem stationären Kern und die Sekundär-Spule mit dem bewegbaren Kern koaxial und relativ zueinander umlaufend angeordnet sind.
6. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der mit dem Sekundär-Schaltkreis (13) bewegte Messfühler (3) seine Energie transformatorisch aus dem Primär-Schaltkreis (11) erhält, dass die vom Messfühler (3) erzeugten Strom- und Spannungs-Messdaten zu der Auswerteeinrichtung (14) gelangen und dass die in digitale Ausgangssignale umgeformten Messdaten einen Kurzschluss erzeuger (15) steuern, welcher den Strom im Sekundär-Schaltkreis (13) gemäss dem Messdatenverlauf kurzschliesst.
7. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die im Primär-Schaltkreis (11) induzierten äquivalenten Strom- und Spannungsänderungssignale über die Auswerteeinrichtung (16) im Primär-Schaltkreis (1) gelangen und dort in verwertbare Ausgangssignale überführbar sind.

Fig. 1

